

$B_1 = 0,01903$ ,  $A_2 = -0,01872$ ,  $B_2 = -0,24863$ . Остаточные напряжения в поверхностном слое торсионного вала, подсчитанные по формулам (3), показаны на рис.4. Как и следовало ожидать, напряжения в поверхностном слое являются сжимающими. Спад напряжений к поверхности объясняется релаксацией в результате заневоливания кручения.

### Л и т е р а т у р а

1. Лурье А.И. Теория упругости. - М.: Наука, 1970.

УДК 620.1.08

Р.А.Михеев

### ПОГРЕШНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕТОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ

Величины компонентов напряжений и деформаций поверхностного слоя испытываемого объекта, определенные в эксперименте по показаниям тензорезисторов, содержат погрешности различной природы /2/. Одним из их источников является измерительная система. Возникают также погрешности вследствие неточного определения упругих постоянных материала исследуемой конструкции. Целью данной статьи является рассмотрение еще одной разновидности погрешностей вызванных неточной ориентировкой тензорезисторов.

Как известно, например /2/, искомые компоненты деформации ( $\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_{xy}$ ) или напряжений ( $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ ) на заданных площадках определяются по деформациям, измеренным тензорезисторами, из соотношений, имеющих вид:

$$\epsilon = \sum_i K_i \epsilon_i, \quad (I)$$

где  $\epsilon$  - искомый компонент ( $\epsilon$  или  $\sigma$ );  $\epsilon_i$  - результат измерений одним из тензорезисторов.

Коэффициенты  $K_i$  определяются углами  $\psi_i$  между осью тензорезистора и некоторой осью, выбранной на объекте в зависимости от конкретной задачи эксперимента. Так, например, для определения

касательного напряжения  $\tau_{xy}$  на площадке, перпендикулярной к оси  $Ox$ , при розетке, состоящей из трех тензорезисторов, оси которых составляют углы  $\varphi_1$ ,  $\varphi_2$  и  $\varphi_3$  с направлением  $Ox$ , коэффициенты  $K_i$  в формуле (I) будут /2/:

$$\begin{aligned} K_1 &= \frac{\sin(\varphi_2 + \varphi_3) \sin(\varphi_3 - \varphi_2)}{\Delta \varepsilon} G, \\ K_2 &= \frac{\sin(\varphi_1 + \varphi_3) \sin(\varphi_3 - \varphi_1)}{\Delta \varepsilon} G, \\ K_3 &= \frac{\sin(\varphi_1 + \varphi_2) \sin(\varphi_2 - \varphi_1)}{\Delta \varepsilon} G \end{aligned} \quad (2)$$

$$\Delta \varepsilon = \sin(\varphi_1 - \varphi_3) \sin(\varphi_2 - \varphi_3) \sin(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Углы  $\varphi_i$  практически могут быть известны только с некоторой погрешностью  $\Delta \varphi_i$ , что и приведет к неточным значениям  $K_i$ , а следовательно, и искомой величины  $\varepsilon(\sigma)$ .

Погрешности  $\Delta \varphi_i$  связаны с неопределенностью положения оси каждого тензорезистора. Ось тензорезистора ориентирована по тому направлению с его чувствительной решеткой направлению, удлинение вдоль которого вызывает наибольшее изменение его электрического сопротивления. Это направление для каждого конкретного экземпляра тензорезистора может быть установлено лишь приближенно, так как зависит от его индивидуальных особенностей (отклонений от номинальной конфигурации чувствительной решетки). На практике принимают, что рассматриваемая ось направлена в основном вдоль продольных элементов чувствительной решетки. Так как сами элементы выполнены с некоторыми неточностями, то такое определение является несколько условным и влечет за собой погрешность  $\Delta \varphi_i$ , даже если последующие измерения углов  $\varphi_i$  выполнить с достаточно высокой точностью.

Можно указать два практически эквивалентных подхода к оценке величины рассматриваемой погрешности компонентов деформаций или напряжений. Прямой способ состоит в следующем. Учтем, что при вычислениях по формулам вида (I) используются значения коэффициентов  $K_i^p$  отличающиеся от истинных ( $K_i^n$ ):

$$K_i^p = K_i^n + \Delta K_i. \quad (3)$$

Поэтому погрешность определения величин  $\varepsilon$  или  $\sigma$  состоит из:

$$\Delta \varepsilon = \sum_i \Delta K_i \varepsilon_i. \quad (4)$$

Величины  $\Delta K_i$  приближенно равны

$$\Delta K_i \approx \sum_j \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \Delta \varphi_j. \quad (5)$$

Применяя известную из теории вероятности (например, [1]) формулу для определения дисперсии суммы (4) случайных величин  $\Delta K_i$  получим:

$$D[\varepsilon] = \sum_i \varepsilon_i^2 D[\Delta K_i] + 2 \sum_{i < n} \varepsilon_i \varepsilon_n K[\Delta K_i, \Delta K_n], \quad (6)$$

где  $D[\varepsilon]$  - дисперсия определяемого компонента деформации или напряжения;  $D[\Delta K_i]$  - дисперсия коэффициента  $K_i$ ;  $K[\Delta K_i, \Delta K_n]$  - корреляционный момент случайных величин  $\Delta K_i$ ,  $\Delta K_n$ , т.е. уклонов коэффициентов  $K_i$  для пары различных тензорезисторов.

Для суммы (5) аналогичная формула имеет, учитывая, что  $\Delta \varphi_i$  некоррелированы, вид:

$$D[\Delta K_i] = \sum_j \left( \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \right)^2 D[\varphi_j]. \quad (7)$$

Корреляционные моменты  $K[\Delta K_i, \Delta K_n]$  при математических ожиданиях  $M[\Delta K_i] = 0$  представляют собой математические ожидания произведений  $\Delta K_i$  и  $\Delta K_n$ :

$$K[\Delta K_i, \Delta K_n] = M[\Delta K_i, \Delta K_n].$$

Подставляя  $\Delta K_i$  и  $\Delta K_n$  по формуле (5), получаем:

$$\begin{aligned} K[\Delta K_i, \Delta K_n] &= M \left[ \sum_j \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \Delta \varphi_j \sum_p \frac{\partial K_n}{\partial \varphi_p} \Delta \varphi_p \right] = \\ &= \sum_{j,p} \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \frac{\partial K_n}{\partial \varphi_p} M[\Delta \varphi_j, \Delta \varphi_p]. \end{aligned}$$

При некоррелированных  $\Delta \varphi_i$  это выражение принимает вид:

$$K[\Delta K_i, \Delta K_n] = 2 \sum_j \left( \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \right)^2 D[\Delta \varphi_j]. \quad (8)$$

Таким образом, имея выражение для  $K_i$  вида (2) и зная  $D[\varphi_i]$

можно по (6), (7) и (8) вычислить искомые дисперсии.

Другой способ основан на отнесении погрешностей, вызванных неточностью определения  $\varphi_i$  к измеренным значениям  $\varepsilon_i$ . Полагая, что коэффициенты  $K_i$  определены правильно, а измеренные значения  $\varepsilon_i$  содержат соответствующие погрешности  $\Delta\varepsilon_i$ . Последнее можно рассматривать как разность удлинений по направлениям, определяемым значением  $\varphi_i^p$ , принятым при расчете  $K_i$ , и действительным значением  $\varphi_i$ . При таком подходе

$$\Delta\varepsilon = \sum_i K_i^p (\varepsilon_i^n - \varepsilon_i^T) = - \sum_i K_i^p \Delta\varepsilon_i, \quad (9)$$

где  $\varepsilon_i^n$  - измеренное значение  $\varepsilon_i$ ;  $\varepsilon_i^T$  - значение  $\varepsilon_i$  по направлению, определяемому величиной  $\varphi_i^p$ .

Величина  $\Delta\varepsilon_i$  приближенно равна:

$$\Delta\varepsilon_i = \frac{\partial\varepsilon_i}{\partial\varphi_i} \Delta\varphi_i. \quad (10)$$

Снова применяя правило определения дисперсии линейной функции случайных величин к сумме (9) и выражению (10) и учитывая при этом, что  $\Delta\varphi_i$  не коррелированы, получим

$$D[\varepsilon] = \sum_i K_i^2 D[\varepsilon_i] \quad (11)$$

$$D[\varepsilon_i] = \left(\frac{\partial\varepsilon_i}{\partial\varphi_i}\right)^2 D[\varphi_i]. \quad (12)$$

Таким образом, искомую оценку погрешности компонента деформаций или напряжений можно, имея выражения для  $K_i$ , найти из выражения (11), подставив туда формулу для  $D[\varepsilon_i]$  - (12). Производную можно найти из известного соотношения

$$\varepsilon_i = \varepsilon_x \cos^2 \varphi_i + \varepsilon_y \sin^2 \varphi_i + \varepsilon_{xy} \sin \varphi_i \cos \varphi_i;$$

дифференцируя это выражение, получим

$$\frac{\partial\varepsilon_i}{\partial\varphi_i} = -(\varepsilon_x - \varepsilon_y) \sin 2\varphi_i + \varepsilon_{xy} \cos 2\varphi_i.$$

Можно показать, что оба подхода приводят к одинаковому результату. Истинные значения искомых величин компонентов  $\varepsilon$  или  $\sigma$  от углов  $\varphi_i$  не зависят. Поэтому дифференцируя (1) по  $\varphi$ , можем приравнять производную  $\frac{d\varepsilon}{d\varphi_i}$  нулю:

$$\frac{d\varepsilon}{d\varphi_j} = \sum \left( \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \varepsilon_i + K_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial \varphi_j} \right) = 0;$$

или учитывая, что  $\frac{\partial \varepsilon_i}{\partial \varphi_j} = 0$ , при  $i \neq j$ :

$$\sum_i \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \varepsilon_i = -K_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial \varphi_i}$$

Умножая левую и правую части этого равенства последовательно на  $\Delta\varphi_j$  ( $j = 1, 2, \dots$ ) и складывая, получим

$$\sum_j \sum_i \frac{\partial K_i}{\partial \varphi_j} \Delta\varphi_j \varepsilon_i = -\sum_i K_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial \varphi_i} \Delta\varphi_i \quad (13)$$

С другой стороны, подставляя (5) в (4) и (10) в (9), получим выражения, совпадающие с левой и правой частями равенства (13) и, следовательно, равные друг другу.

Используя общий подход для анализа погрешностей тензорозеток, применяемых на практике конфигураций, получим: для одиночного тензорезистора, наклеенного для определения  $\varepsilon_x$ :

$$D[\varepsilon_x] = \varepsilon_{xy}^2 D[\varphi];$$

для розетки из двух тензорезисторов для определения  $\varepsilon_x$  и  $\varepsilon_y$  ( $\varphi_1 = 0$ ,  $\varphi_2 = 90^\circ$ ):

$$D[\varepsilon_x] = D[\varepsilon_y] = E^2 \frac{1+\mu^2}{(1-\mu^2)^2} \varepsilon_{xy}^2 D[\varphi];$$

для розетки из двух тензорезисторов для определения  $\varepsilon_{xy}$  или  $\tau_{xy}$  ( $\varphi_1 = 45^\circ$ ,  $\varphi_2 = -45^\circ$ ):

$$D[\varepsilon_{xy}] = 2(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 D[\varphi];$$

для розетки из трех тензорезисторов с углами  $\varphi_1 = 0$ ,  $\varphi_2 = 45^\circ$ ,  $\varphi_3 = 90^\circ$ :

$$D[\varepsilon_x] = D[\varepsilon_y] = \varepsilon_{xy}^2 D[\varphi]$$

$$D[\varepsilon_{xy}] = 2[\varepsilon_{xy}^2 + 2(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2] D[\varphi]$$

$$D[\varepsilon_x] = D[\varepsilon_y] = E^2 \frac{1+\mu^2}{(1-\mu^2)^2} \varepsilon_{xy}^2 D[\varphi];$$

для розетки из трех тензорезисторов с углами  $\varphi_1 = 0$ ,  $\varphi_2 = 60^\circ$ ,  $\varphi_3 = 120^\circ$  (так называемая  $\Delta$ -розетка):

$$D[\varepsilon_x] = \varepsilon_{xy}^2 D[\varphi]$$

$$D[\varepsilon_y] = \left[ \frac{\varepsilon_{xy}^2}{3} + \frac{2}{3} (\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 \right] D[\varphi]$$

$$D[\varepsilon_{xy}] = \frac{2}{3} [\varepsilon_{xy}^2 + 3(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2] D[\varphi]$$

$$D[G_x] = E^2 \frac{1}{(1-\mu^2)^2} \left[ \left(1 - \frac{2}{3}\mu + \frac{\mu^2}{3}\right) \varepsilon_{xy}^2 + \frac{2}{3}\mu^2 (\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 \right] D[\varphi]$$

$$D[G_y] = E^2 \frac{1}{(1-\mu^2)^2} \left[ \frac{2}{3} (\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3}\mu + \mu^2\right) \varepsilon_{xy}^2 \right] D[\varphi]$$

$$D[\tau_{xy}] = G^2 D[\varepsilon_{xy}].$$

Полученные формулы позволяют определить погрешности компонент деформаций или напряжений в зависимости от конфигурации применяемой тензорозетки, напряженно-деформированного состояния объекта испытаний и величины погрешностей углов  $\varphi_i$ .

Воспользуемся результатом для одиночного тензорезистора и найдем относительную среднеквадратическую погрешность (коэффициент вариации):

$$\gamma[\varepsilon_x] = \frac{\sqrt{D[\varepsilon_x]}}{\varepsilon_x} = \frac{\varepsilon_{xy}}{\varepsilon_x} \sqrt{D[\varphi]}.$$

Пусть деформированное состояние объекта таково, что  $\varepsilon_{xy} \cong \varepsilon_x$ , тогда

$$\gamma[\varepsilon_x] = \sqrt{D[\varphi]} = G[\varphi].$$

Если среднеквадратическая погрешность выдерживания угла  $\varphi_i$  составляет всего  $1^\circ$ , то относительная среднеквадратическая погрешность определения  $\varepsilon_x$  будет около 2%.

Таким образом, рассматриваемая в статье погрешность может быть существенной по величине, а к точности наклейки тензорезисторов должны предъявляться высокие требования.

#### Л и т е р а т у р а

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1969. - 576с.
2. Михеев Р.А. К вопросу оптимизации розеток тензорезисторов, используемых при экспериментальных исследованиях. - В кн.: Прочность, устойчивость и колебания тонкостенных конструкций. - М.: МАИ, 1981.